⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平3-105841 ⑫公開特許公報(A)

@Int.Cl. 5

織別配号

庁内整理番号

個公開 平成3年(1991)5月2日

49/26 27/62 H 01 J G 01 N

7247-5C 7529-2G

G

審査講求 未請求 請求項の数 25 (全14頁)

質量分析方法及び装置 会発明の名称

> 頭 平1-242195 ②1特

> > 剛

頤 平1(1989)9月20日 223出

個発 明 者 北 森 武 彦

茨城県日立市森山町1168番地 株式会社日立製作所エネル

ギー研究所内

正 治 明 坂 H. 個発 者

茨城県日立市森山町1168番地 株式会社日立製作所エネル

ギー研究所内

正太佳 古賀 個発 明 者

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

水 72)発 明 者 西 垂

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

株式会社日立製作所 の出 願 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

外2名 弁理士 小川 勝男 四代 理 人

最終頁に続く

1. 発明の名称

資量分析方法及び装置

- 2.特許請求の範囲
 - 1、試料をイオン化し、発生したイオンを質量分 析する質量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をブレイクダ ウンさせるとともに、レーザ光の出力密度をブ レイクダウンにより発生するイオンが低荷電数 のイオンとなるように調整し、該イオンを質量 分析することを特徴とする質量分析方法。

2. 試料をイオン化し、発生したイオンを質量分 折する費量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をプレイクダ ウンさせるとともに、レーザ光の出力密度をブ レイクダウンにより発生するイオンが主に単一 電子数のイオンとなるように調整し、該イオン を質量分析することを特徴とする質量分析方法。

3.試料をイオン化し、発生したイオンを質量分 析する質量分析方法において、

盆野にレーザ光を照射して試料をプレイクダ ウンさせてプラズマ化し、滾プラズマから原子 発光線または低荷電数のイオンの発光線が発生 したときにイオンを引き出し、該イオンを質量 分析することを特徴とする質量分析方法。

4.試料をイオン化し、発生したイオンを質量分 析する質量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をプレイクダ ウンさせてプラズマ化し、前記プラズマ中のイ オンが単一電子数または低荷電数のイオンにな るまでの時間を経過した後中性原子になるまで 間にプラズマからイオンを引き出し、該イオン を質量分析することを特徴とする質量分析方法。

5。 試料をイオン化し、発生したイオンを質量分 折する質量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をブレイクダ ウンさせてプラズマ化し、旗プラズマから原子 発光線または低荷電数のイオンの発光線を観測 したときにイオンを引き出し、該イオンを質量 分析することを特徴とする質量分析方法。

6 ・ 特許請求の範囲第5項記載の質量分析方法に おいて、

前記イオンの引き出しは、前記原子発光線または低荷電数のイオンの発光線の強度が所定の設定値を越えたときに行うことを特徴とする質量分析方法。

7. 試料をイオン化し、発生したイオンを質量分析する質量分析方法において。

試料にレーザ光を照射して試料をブレイクダウンさせてプラズマ化し、前記プラズマ中のイオンを飛行時間型質量分析計で単一電子数または低荷電数のイオンとして質量分析することを特徴とする質量分析方法。

8. 関体試料をイオン化し、発生したイオンを質量分析する質量分析方法において。

固体試料に出力密度が1010~1011W/cd のレーザ光を照射して固体試料をブレイクダウンさせてイオン化し、該イオンを質量分析することを特徴とする質量分析方法。

9.被体試料をイオン化し、発生したイオンを質

気体試料に該気体試料中の被消状物質はブレイクダウンするが気体はブレイクダウンしない 出力速度のレーザ光を照射し、前配液液状物質 がブレイクダウンしたときに 発生 したイオンを 質量分析することを特徴とする質量分析方法。

13. 試料をイオン化し、発生 した イオンを質量 分析する質量分析方法におい で。

試料を挟んで配置した電極により試料に電圧を印加して試料をプレイクダウンさせるとともに、印加する電圧をプレイクダウンにより発生するイオンが低荷電数のイオンとなるように調整し、該イオンを質量分析することを特徴とする質量分析方法。

14. 試料をイオン化するイオン化館、 該イオン 化部で発生したイオンを費量分析 する質量分析 部から成る質量分析装置において、

前記イオン化部の試料をイオン 化 させる手段 として、前記試料にレーザ光を 照 射 したときに 試料がプレイクダウンするとと も に 該 ブレイク ダウンにより発生するイオン が 低 荷 電 数 のイオ 量分析する費量分析方法において、

被体試料に出力密度が10¹¹~10¹²W/cli のレーザ光を照射して被体試料をプレイクダウ ンさせてイオン化し、該イオンを質量分析する ことを特徴とする質量分析方法。

10. 気体試料をイオン化し、発生したイオンを 費量分析する費量分析方法において。

気体試料に出力密度が1012~1012W/cil のレーザ光を照射して気体試料をプレイクダウ ンさせてイオン化し、該イオンを質量分析する ことを特徴とする質量分析方法。

11. 試料をイオン化し、発生したイオンを貿量 分析する質量分析方法において、

気体又は被体試料に該気体又は液体試料中の 粒子状物質のみがプレイクダウンする出力密度 のレーザ光を照射し、前記粒子状物質がプレイ クダウンしたときに発生したイオンを質量分析 することを特徴とする質量分析方法。

12. 試料をイオン化し、発生したイオンを質量 分析する質量分析方法において、

ンとなるようにレーザ光の出力密度を調整した ・レーザ光照射装置を用いることを特徴とする質 量分析装置。

15. イオン発生用の試料を収容する装置と.

前記試料にレーザ光を照射して試料をブレークダウンさせてプラズマ化させるレーザ光照射 物質と

前記プレイクダウンさせたときのプラズマ中のイオンが単一電子数または低荷電数のイオンになるまでの時間を経過した後中性原子になるまで間にプラズマからイオンを引き出す装置と、

該引き出されたイオンを質量分析する手段と を有することを特徴とする質量分析装置。

16. 特許請求の範囲第14項または第15項に 記載の質量分析装置において、

前記費量分析部(費量分析する手段)が飛行時間型費量分析計であることを特徴とする費量分析能をあることを特徴とする費量分析物間。

17. イオン発生用の試料を収容する装置と、 前記試料にパルスレーザ光を照射して試料を ブレークダウンさせてプラズマ化させるレーザ 光照射装置と、

前記プレイクダウンさせたときのプラズマ中のイオンが単一電子数または低荷電数のイオンになるまでの時間を経過した後中性原子になるまで間にプラズマからイオンを引き出す装置と、

該引き出されたイオンを質量分析する飛行時 関型質量分析計と

を有することを特徴とする質量分析菽園。

18. 特許請求の範囲第17項に記載の費量分析 装置において

前記イオンを引き出す装置は、イオン取り出し電機を有し、前記パルスレーザ光を照射する 時刻より所定の設定時間遅らせてイオン取り出 し電価に電圧を印加するようにしたものである ことを特徴とする費量分析装置。

19. 特許請求の範囲第17項に記載の質量分析 装置において、

前記イオンを引き出す装置は、イオン取り出 し電福と、プラズマ発光を分光測定する装置を

前記試料は気体又は液体試料であり、

前記レーザ光照射装置から前記試料に照射されるレーザ光の出力密度は、前記気体又は液体試料中の粒子状物質のみがブレイクダウンする出力密度となるように調整されたものであることを特徴とする質量分析装置。

23.イオン発生用の試料を収容する装置と、

前記試料にパルスレーザ光を原射して試料を ブレークダウンさせて プラ ズマ 化させるレーザ 光照射装置と、

前記プレイクダウンさせたときのプラズマか らイオンを引き出す**装置と**、

該引き出されたイオン を 質量分析する飛行時 簡型質量分析計と

前記飛行時間型質量分析計のイオンデフレクタを前記レーザ光照射装置のパルスレーザ光の 照射時期と対応させて作動させる装置と.

前記イオンデフレク 岁 の 作 助 時 期 に 対応させ て 検出したイオン電流 を 信 号 処 理 す る 装 区 と を 有することを 特 微 と す る 質 量 分 析 装 置 。 有し、該分光測定裝置で原子発光線または低荷電数のイオンの発光線が額測されたときに前記 イオン取り出し電極に電圧を印加するようにし たものであることを特徴とする質量分析装置。

20. 特許請求の範囲第19項に記載の授金分析 装置において、

前記イオン取り出し電極への電圧の印加を前記原子発光線または低荷電数のイオンの発光線の強度が所定の設定値を越えたときに行うようにしたことを特徴とする質量分析装置。

21. 特許請求の範囲第15項または第17項に 記載の費量分析装置において、

前記試料を収容する装置は、液体又は気体試料を絞り込む機構を有し、前記レーザ光照射装置は、前記液体又は気体試料を絞り込んだ個所に試料がプレイクダウンする出力密度のレーザ光を照射するようにしたことを特徴とする質量分析装置。

22.特許請求の範囲第14項または第15項または第17項に記載の費量分析装置において、

- 2.4. イオン発生用の試料と、該試料にレーザ光 を照射したときに試料がプレイクダウンすると ともに該プレイクダウンにより発生するイオン が低荷電数のイオンとなるようにレーザ光の出 力密度を調整したレーザ光照射装置とを有する ことを特徴とするイオン源。
- 25、イオン発生用の試料と、該試料にレーザ光 を照射して試料をプレイクダウンさせてプラズ マ化するレーザ光照射装置と、前記プラズマ中 のイオンが単一電子数または低荷電数のイオン になるまでの時間を経過した後中性原子になる まで間にプラズマからイオンを引き出す装置と を有することを特徴とするイオン源。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本売明は質量分析方法及びその装置に係り、特 にレーザ光により試料をイオン化することにより 質量分析する方法及び装置に関する。

[従来の技術〕

従来の質量分析装置では、イオン化に例えばグ

ロー放電を用いた大気圧イオン化法などが用いられている。しかし、この方式ではイオン化できるのは気体試料に歴史されていた。

また、レーザを付まる3回かれのでは、 置として、何えば第23回が93,135及び137頁(1888) 取京討論会講演要は多のがある。これらは、試料に レーザ光を限射してがある。これらは、は料に レーザ光を限射してが出出かけれるもく、オオであるが、照射するレーザ光の発出の単純なでは、 を取射してが、原射してが出れないである。 表面にレーザ光をであるがある。これの単純ないは、 であるイオールである。これのは、 であるイオールである。 を限射してが、の単純なである。 を取射してが、であると、イオでいた。 やスパンタリングによりくなでは、 ですったが、は到ったがかまた。 で表面の分析などに分析対象は限定されていた。

また、レーザ光を試料に照射してイオンを発生 させて各種処理操作をする方法として以下に述べ るようなものがある。

特公昭58-46340 号公報には、レーザ光線をタ ーゲツトに限射しターゲツト材をイオン化してイ オンを質量分光により同位体分離する方法につい

西ドイツ特許公開公報第 25 20 10 号 には レーザ系 着装置で生成したプラズマ 中 の イ オ ン を 質量分析 計で分析する方法について 記 載 さ れ て い る。レー ザ森着装置では、 基板上に 森 着 さ せ る 物 質 の 材料 にレーザ光を 服射してその 物 質 を 燕 発 さ せ 原子 ま

て記載している。この方法は、同位体の分離を目 的としたものであり、高い効率でターゲントをイ オン化するように極めて高強度のレーザ光線を使 用し、発生したイオンも単一電子の荷電状態の10 倍以上の高荷電状態となるようにしている。この ため生成したプラズマ内では、同一元素に対し10 以上の異なる荷電状態をもつことになり、これを 質量分析計で同位体分離すると、餌一元素に対し その荷電状態に応じてでノm(てはイオン個数。 mは質量)が異なるため別々のデポジンタ(同位 体補集器)に分離して補集されることになる。タ ーゲツト材料の組成分析においては、同一元飛が 質量分析計の同一補集器に補集できれば高感度と なるが、この例では元素が同一でも荷電状態によ り別々の補集器に補集され、虫た、異なる元素で 同一の2/ m の値をもつ荷電状態のイオンは同一 の補集器で補集される。このため、この方式のイ オン化の方法は、本発明の目的である材料の組成 分析に必要な質量mのみの分離定量には適切では ない.

たは分子状にする。このとき蒸発した原子や分子 の一部がレーザ光の照射を受けて電離しイオンに なる。通常はこのイオンや原子・分子は囲りのイ オンや原子・分子と衝突して合体し微小なクラス ターを形成するが、このうち電荷をもつたクラス ターやイオンが健極により引き出され越板上に導 かれ、付着して確膜を形成する。この蒸発したガ ス中には中性の原子・分子及びそれらのクラスタ ー、及びこれらの電離されたイオンが混在してい るのが通例である。蒸着物質の質量や荷電数を観 祭するため、イオン成分を質量分析 計に導き質量 分析している。この質量分析では、蒸着過程で生 成した蒸発原子・分子・イオン及びそのクラスタ 一の中のイオン成分を利用するものであり、材料 の元素分析(原子組成分析)を目的として材料を 稜筏的にかつ効率よく原子状にしかつイオン化し て仗量分析するものではない。

[発明が解決しようとする課題]

上記費量分析における從来技術では、質量分析 する対象が気体や固体表面に限られており、質量 分析の対象を広げることができないという問題が ある。

また、上記レーザ光を用いて試料をイオン化し、各種処理操作を行う従来技術では、材料の組成分析を行う質量分析には適さない。 即ち、 これらの 従来技術を質量分析の分野に適用しても、 レーザ 光照射により分析対象とする材料をイオン化する 際、質量分析に適する低荷電状態のイオンが効率 よく生成されないという問題がある。

また、上記従来の技術では、例えば、液体や気体中の粒子成分を分析する際に粒子成分のみを選択的に、かつ効率よくイオン化する点に配慮されておらず、固体、液体、気体など種々の形態の材料を高感度に成分分析することが困難である。

なお、従来、レーザ光を用いて試料を分析する 方法として、レーザプレイクダウンを用いる分析 方法があが、レーザプレイクダウンを用いる分析 方法では、例えばジヤパニーズ・ジヤーナル・オ ブ・アプライド・フィジツクス、27。(1988年)第 L983頁~第L985頁(Japanese Journal of

したイオンを小型で簡便な装置により費量分析する方法及び装置を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、質量分析等に好適な低荷電数のイオンを効率よく生成するための分析対象等のイオン化の装置を提供することにある。 (課題を解決するための手段)

上記目的を遠成するために、質量分析の対象物質(試料)のイオン化の方法として、レーザ光照射により分析対象物質の一部または全部をプレイクダウン(絶縁破壊の一種)させる方法を用いる。

また、試料にレーザ光を照射して試料をプレイ クダウンさせるときのレーザ光の出力密度をプレ イクダウンにより発生するイオンが低荷電数のイ オンとなるように調整する。

また、パルス状のレーザ光を照射して分析対象 物質を瞬時にブレイクダウンさせプラズマ化した 後、生成した高荷電数のイオンが電離した電子と 再結合して単一電子数または低荷電数のイオンに なるまでのある時間を経過した後、プラズマ中の イオンを取出し、質量分析袋置に導く。 Applied Physics 27,(1988)pp.L983ーL985) に記載のように発生する音響波を用いて被体中の微粒子を計数したり、また、アプライド・スペクトロスコピー38(1984年)第721頁 ~ 第729頁(Applied Spectroscopy 38,(1984)pp.721-728) に記載のように、レーザブレイクダウンにより発生したプラズマ発光を分光して波体の成分分析をしており、レーザブレイクダウンにより発生するイオンを用いて質量分析をしていなかつた。

本発明の目的は、分析対象が限定されない質量分析方法及び装置を提供することにある。

本発明の他の目的は、質量分析に好適な単一電子数またま低荷電数のイオンのみを効率よく得て 質量分析する方法及び装置を提供することにある。

本発明の他の目的は、固体や被体、気体、又は 液体や気体中に含まれる固形状物質(粒子状物質) を選択的にイオン化して高感度で質量分析する方 法及び装置を提供することにある。

本発明の他の目的は、瞬時にイオン化して生成

また、固体や被体、気体、あるいは液体や気体に含まれる粒子状物質に対し、それぞれの対象をブレイクダウンに到らせるに必要なレーザ光の出力密度を適切に設定することにより、固体、液体、気体のうちの特定の形態の物質を選択的にブレイクダウンさせる。

さらに、パルス状のレーザ光照射により分析対象物質をブレイクダウンさせプラズマ化して生成したイオンを飛行時間型質量分析計により質量分析する。

さらに、レーザ光照射によりプレイクダウンし て発生するイオンは質量分析以外にも広い分野で イオン額とすることができるため、このイオン化 法をイオン加速器などのイオン源とする。

[作用]

パルス状のレーザ光などを凸レンズなどにより 集光し、光出力密度を10 ¹⁰ W / d 以上にして物 質に照射すると、物質はレーザ光の熱的及び光学 的ならびに電磁気的作用により一瞬にして破壊し プラズマ化する。この現象をレーザブレイクダウンと呼ぶ。レーザブレイクダウンにより生成した プラズマ中にはイオンと電子が混在する。したがつて、レーザブレイクダウンにより物質をイオン 化することができる。発生したイオンはプラズマ中で電子と再結合して中性原子となるため、 再結合して中性原子になる前にイオンを取出し質量分析する。

プレイクダウンプラズマが生成された後、原子 発光線が観測され始める時点でプラズマに併えば 電磁気力などを作用させれば、1 値イオンを効率 よく取出すことができる。

次に、物質をブレイクダウンさせるために必要 なレーザ光の出力密度は、物質の形態すなわち固 体、液体、気体のそれぞれに対して異なる。光出 力密度が10 º ♥ / off レベルで 固体の レーザブレ イクダウンが生じ、1011Wノロシベルで液体の、 10¹²W/ピレベルで気体のシーザブレイクダウ ンが起る。したがつて分析対象の試料の形態に応 じて光出力密度を進当に設定することにより、分 析対象を選択的にプレイクダウン し、 イオン化す ることができる。とくに、光出力密度を液体のブ レイクダウンしきい値より小さい 1010W/可程 皮とすると固体のみをプレイク ダウン することが できる。したがつて、この光出力密度で気体また は液体試料にシーザ光を照射すると 媒 質 は ブレイ クダウンせずに媒質中の粒子 状物 熨 の み を ブレイ クダウンさせることができる。 した がつ て・レー

溶粧のプレイクダウン直後ではNaは1価または 低価数のイオンとなり種々の励起状態となりうる ため、励起状態に応じてそれぞれ異なる彼長の光 を放出し、その結果白色光が觀測される。ブレイ クダウン発生後の時間の経過に伴つて、多飯イオ ン状態のNaが電子と結合しNaの1 踊イオンが 生成し、このNaの1価イオンと電子が再結合し て中性Na原子になつた際結合した電子が基底状 想に遷移してNaの原子発光線 (D線)を放出す る。第13週では、約300m秒経過後より原子 発光線が明瞭に観測されており、ブレイクダウン により発生したプラズマの消滅過程で Naの 1 価 イオンが多数生成されることがわかる。また、ブ レイクダウン後約300n秒の短時間が経過した 時点でつよいNa原子発光線を観測したことは、 この時点までの短時間の間にすでに多数のNal 価イオンが生成していることを意味し、このよう なブレイクダウンプラズマでは1個または2個程 度の低荷電数のイオンが多数生成していると考え Sta.

ザ光の出力密度を1010W/d程度とすることにより、気体や液体中の粒子状物質を選択的にイオン化し、度量分析することができる。さらに、レーザブレイクダウンでは物質が활体、半導体、結験体であつてもブレイクダウンによりイオン化できるため、気体や液体中の金属や酸化物など広い範囲の化学形態の物質をイオン化することが可能となる。

ラズマ中のイオンを例えば電圧を印加した電極等により引出し、飛行時間型質量分析計に導く。電極の印加電圧をVとすると、質量m,荷電数(価数)qのイオンの速度vは(1)式により与えられる。

$$\frac{1}{2} \text{ m } \text{ v }^2 = \text{ q } \text{ V} \qquad \cdots (1)$$

したがつて、飛行距離しの飛行時間型質量分析 計において、イオンの飛行時間 T は (2)式のよう になる。

$$T = \frac{L}{v} = \sqrt{\frac{m}{2 \text{ q V}}} \cdot L \qquad \cdots (2)$$

$$\therefore \frac{m}{v} = \frac{2 T^{2} V}{v} \qquad \cdots (3)$$

パルス市10 n s 。出力100m Jのレーザ光 13は集光レンズ2により収束させ、気体用ブレ イクダウンチェンパ3に入射する。レーザ光13 はブレイクダウンチェンパ3の内部で焦点を結び、 焦点付近で気体のレーザブ レイクダウンを誘起す る。レーザブレイクタウンによりイオン化する気 体試料は試料導入路4を通つてブレイクダウンチ エンパ3に導かれ、排出される。プレイクダウン チェンパ 3 内でレーザブレイクダウンによりプラ ズマ化され、イオン化された気体試料の構成原子 はブレイクダウンチェン パの スリツトを経て加速 単極5により加速され、 飛行 時間 型質量分析装置 (TOP) のイオンディフ レクタ 6 に導入される。 イオンディフレクタ6は パル スYAGレーザ1と 両期して作動し、レーザブ レイクダウンによる気 体試料のイオン化と同時に 生成 したイオンをイオ ンコレクタフに導入する。 イオンコレクタ7から のイオン電流11はイオン デ イ フレクタ 6 の作動 開始時期を基準として信号 処理 装置 9 により処理 され、飛行時間覚量スペク トル (TOFスペクト

選時刻、またはプラズマ発光の観選時刻、もしくはこれらの時刻よりある一定時刻遅れた設定時刻などを選定すればよい。また、プラズマからイオンを取出すための電極への電圧印加のタイミングとして、パルスレーザ光の照射前の任意の時刻、またはプラズマ発光に原子発光線や1 価または低価数のイオンの発光線を観測した時刻などを選定する。

レーザブレイクダウンにより発生するイオンを加速器などのイオン顔として利用することもできる。レーザブレイクダウンにより様々な形態の試料をイオン化することができ、また、元素の種類によらずイオン化することができる。したがつて、レーザブレイクダウンにより広い範囲の物質をイオン顔とすることができる。

【实旅假】

以下、本発明の一実施例を第1図から第12図 により説明する。

第1回は本発明の基本構成図を示す。パルス YAGレーザ1から発生する彼長1064nm,

ル)を得る。パルス発生器 8 はパルス Y A G レーザ1, イオンデイフレクタ 6 及び信号処理装置 9 を同期して作動させるための制御信号 1 0 を発生させる。

第2回は本発明の別の実施例である。第1回と のちがいは、信号遅延制御装置31と電圧印加袋 置32及びイオン取出し電艦33を設けた点にあ る。信号運延制御装置31によりパルス発生器8 でのパルス信号発生の時刻よりある設定時間だけ 遅らせた時刻に電圧印加数置32を作動させイオ ン取出し電援33に電圧を印加させる。プレイク ダウンチェンパ3内で液体試料がパルスレーザ光 の照射によりプレイクダウンされプラズマ化して イオン化した被体試料の構成原子が、電機33に 電圧を印加した時点で引出され、加速電揺 5 によ り加速され、飛行時間型質量分析装置のイオンデ イフレクタ6に導入される。この方法により、試 料がプレイクダウンしてプラズマ化した役ある設 定時間の後にプラズマ中のイオンを引出して賃量 分析することができる。電圧印加装置32を作動 させるタイミングとして、第2回の実施例以外に プラズマ発光を分光調定し、原子発光線または1 価1イオンの発光線の強度がある設定値を越える かどうかを判定し、発光線強度が設定値を越えた 時刻で作動タイミングを与えてもよい。

第3回は本実施例の真空系の得成を示す。プレイクダウンチェンパから成るイオン化部14は大気圧であり、加速電優を含む差動排気部15はターボ分子ポンプ17により10¹ Paに排気され、さらにTOPから成る質量分析部16は10⁻² Paに抑気される。したがつて、本実施例では大気圧下で生成したイオンは高真空側に導入され、質量分析される。

第4図は気体試料用のブレイクダウンチエンバ 3の構造を示す。気体試料は試料導入路4を通っ てブレイクダウンチエンバ3に導入される。レー ザ光13は集光レンズ2により収束し、光学窓 18よりブレイクダウンチエンバ3内に照射し、 再び光学窓18を経てブレイクダウンチエンバ3 の外側に設置されたビームストンパ12により吸

光13は集光レンズ2により集光され、光学窓 21よりプレイクダウンチェンパ20に導入され る。レーザ光は円錐状のブレイクダウンチェンバ 20の内壁面に沿つて集光され、 ブレイクダウン チェンバ20の細口よりチェンバ外へ出たところ で焦点を結ぶ、したがつて、 ブレイクダウンチエ ンパ20の下部組口を出た試料の細口流れの途中 ででレーザ光は焦点を結び。 試料 のプレイクダウ ンが誘起される。このように して 被 体 試料は大気 中でレーザブレイクダウンに よ り イ オ ン 化 される・ この液体用のブレイクダウン チ エ ンパ は第 1 図に おける気体用のブレイクダウ ン チ エン パ 3 に置き 換えて使用する。 焦点における レーザ光の出力密 度を10¹¹W/di以上に設定すると被体試料をブ レイクダウンしイオン化する ご と が で き、 被体の 成分分析が可能となる。また、 熾 点 に おける レー ザ光の出力密度を10ºW/callに 設定すると液体 中の粒子状物質のみをブレィ グ ダ ウ ン し ・ イオン 化することができる。 したがつ て . この条件下で は、被体中の粒子状物質のみ成 分 分 折 することが

第5回は液体試料用のプレイクダウンチエンパの構造を示す。液体試料は試料導入管19を経て円錐状のプレイクダウンチエンパ20に導入たれる。円錐状のプレイクダウンチエンパ20の上面は光学窓21となり、また、下部は細口が開いており、液体試料はこの細口を経て緩めて細い流れとなり、試料排出管22より排出される。レーザ

できる.

第5 図では、プレイクダウンチエンバ2 0 の下部細口を出た液体の概い流れの部分にレーザ光の 焦点を結ばせてプレイクダウンさせたが、こい リに、下部細口2 7 を出た液体試料の液滴にレーザ光の 焦点を結ばせて被体試料をプレイクダウン させてもよい。また、レーザ光を液体試料の から限射する代りに、水平方向から液体試料の が洗れまたは液滴に焦点を結ぶように 照射して 後でプレイクダウンさせてもよい。

第6図は固体試料用のブレイクダウンチエンバの構造の例を示す。ブレイクダウンチエンバ26内に設置した試料台23上に固定し、焦点レンする。 図外央面は10°~10^{11W}/の光出力密度でプレイクダウンに到るため、ルーザ光の出力密度でもこの範囲に改定する。 固体用ブレイクダウンチェンバ3と置き換えて使用する。

第7図には固体試料用のブレイクダウンチエン

パの別の英雄例を示す。この実施例では、試料台23を移動して試料24の任意の位置にレーザ光を服射できるようにするため、試料台駆動制御装置44を設けている。

第8回及び第2回は、第6回回は、第7回回は、第5回回は、第5回回は、第5回回のの高い、第5回回のの高い、第5回回のの高い、第5回回を使用が大大、5を乗り、第2をを取り、第2をを取り、42をを取り、42をを取り、42をできる。42をできるる。42をできるる。42をできるる。42をできる。42をできるる。42をできるる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42をできる。42

第10回に飛行時間型質量分析装置の一実施例 を示す。プレイクダウンにより発生したイオンは イオン飛行チューブ51内に設置されたイオン取

液体をブレイクダウンし、イオン化する別の方法の実施例を第12回に示す。液体容器70の下部はロード状で、その先端に細孔が設けられている。容器下部細孔から流出した細線状または液液状の試料液体は、対向して設けられた電低71の関係を通り落下する。電低71には、電圧印加制御装置73からの制御信号により電源72を作動

第11関には飛行時間型質量分析装置の別の実施例を示す。イオン飛行チューブ51内には電框52及び53の他に、新たに電極61。63。 84及び電標61の電圧制御装置62が設けられている。イオンデイフレクタ53を通過したイオ

させ、パルス状に高電圧を印加する。電極 7 1 への印加電圧として組織破壊しきい電圧(約 1 0 8 V $/ <math>\infty$ 程度)を上まわる値に設定する。

第14回はレーザ光により試料をイオン化させた実施例において測定した気体中の粒子状物質のTOFスペクトルを示す。TOFスペクトルには質量数28のSi及び質量数16のOのピークが主として検出され、粒子状物質の主たる成分がSiOzであることがわかる。また、質量数44のピークはSiOzでのピークと関定される。

本実施例において、TOFによる質量分析部を イオン加速器とすることにより、プレイクダウン チエンバを加速器のイオン源として使用すること もできる。

(発明の効果)

本発明によれば以下の効果がある。

- 1) 気体, 液体, 固体等試料の形態を関わずイオン化でき、分析することができる。
- 2) 気体中、あるいは液体中の粒子状物質を選択

的にイオン化し、分析することができる。

- 3) 絶縁体。平準体、導体等試料の性質を問わず イオン化でき、分析することができる。
- 4) イオン化ポテンシャルの高い物質でも容易に レーザブレイクダウンに到るためイオン化でき、 分析することができる。
- 5) レーザブレイクダウンにより1個または低荷電数のイオンを効率よく生成することができ、 高感度の分析が可能である。
- 6)上記1)~4)に記載の形態及び性質の物質 をイオン化することができ、それらを加速器等 のイオン源とすることができる。
- 7)上記1)~4) に記載の形態及び性質の物質でも微量成分分析ができる。
- 8) レーザ光の光出力密度を変化させることにより分析対象物質を選択することができる。
- 9) レーザ光の光出力密度を変化させることにより、成分分析を元素分析、あるいは分子の分析とすることができる。
- 10) レーザブレイクダウン法と飛行時間型質量分。

12…ピームストツパ、13…レーザ光、14…

析法の組合せにより、小型で低コストの高感度 成分分析が可能である。

4. 図面の簡単な説明

1 … パルス Y A G レーザ装置、 2 … 集光 レンズ、 3 … ブレイクダウンチエンバ、 4 … 試料導入路。 5 … イオン加速電極、 6 … イオンデイフレクタ、 7 … イオンコレクタ、 8 … パルス発生器、 9 … 佰 号処理装置、 1 0 … 假御信号、 1 1 … イオン電流、

イオン化部、15… 差動排気部、16… 質量分析部、17… ターボ分子ポンプ、18… 光学窓、19… 液体試料導入管、20… 液体試料用プレイクダウンチェンバ、21… 光学窓、22… 液体試料出管、23…試料台、24… 固体試料、25… 光学窓、26… 固体試料用プレイクダウンチェンバ、27…イオン、28… 液体試料、31… 借号退延制御装置、32… 電圧印加装置、33…イ

オン取出し健極、41,43…集光レンズ系、 42…コアイバ、44…試料台駆動制御装置、

45.46…集光レンズ系 那 動 飼 御 装 置 、51… イオン飛行チューブ、52…イオン 取出し 電 優、

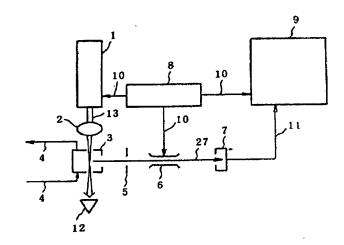
53…イオンデイフレクタ、 5.4 … イオン検出器.

55…原子传出器、56。57…真空俳気装置、

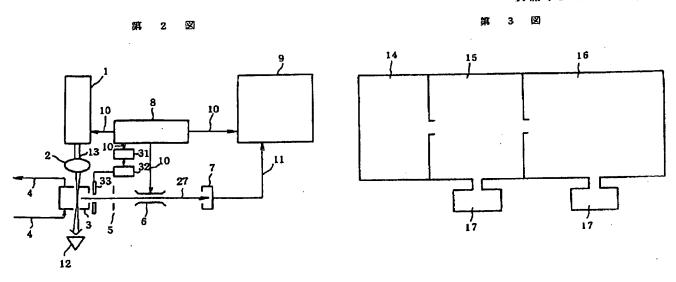
61,63,64…電腦、62…電圧網御装置。

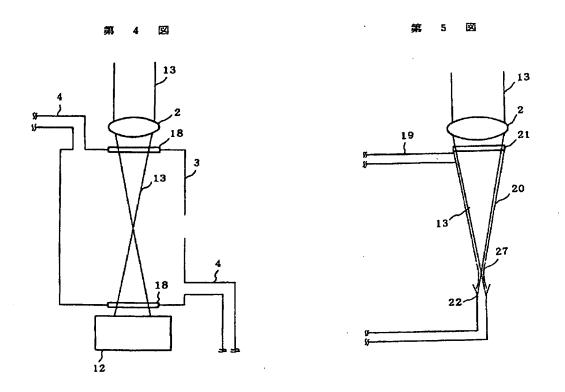
代理人 弁理士 小川勝寒

第1 1 152



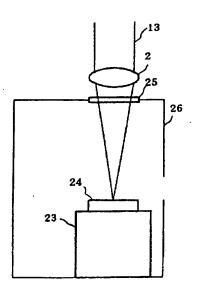
特閒平3-105841 (11)

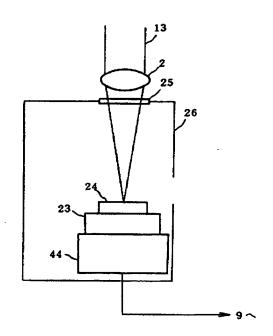


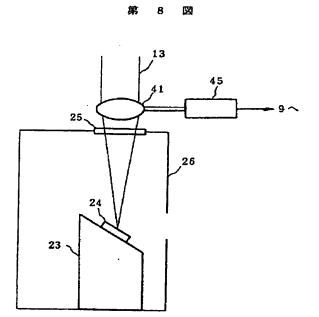


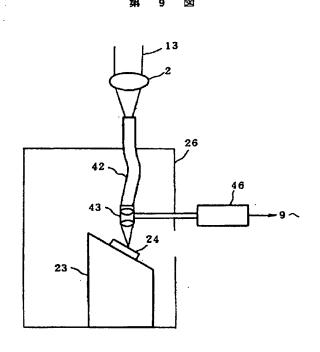
特朗平3-105841 (12)





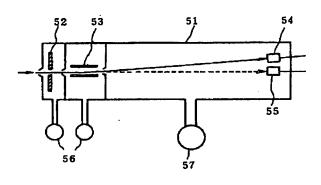


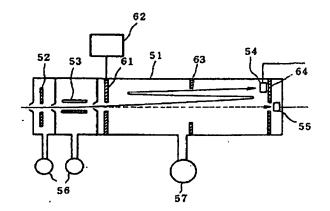




特閒平3-105841 (13)

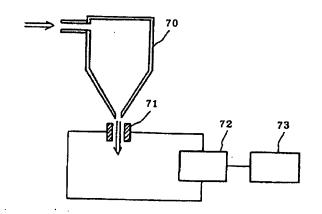
第 10 図



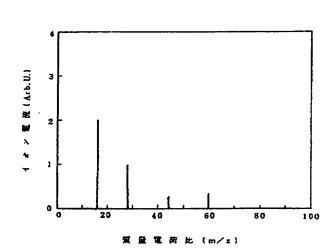


第 11 図

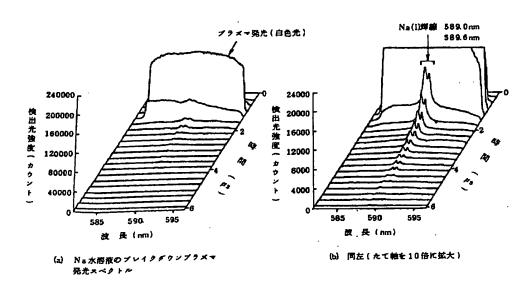
第 12 図



紅 14 図



第 13 図



第1頁の続き @発 明 者 松 井 哲 也 茨城県日立市森山町1168番地 株式会社日立製作所エネル ギー研究所内 @発 明 者 横 瀬 賢 次 茨城県日立市森山町1168番地 株式会社日立製作所エネル ギー研究所内